


**薬学研究科**

- 高精密度質量分析装置 (1)  
(Thermo Fisher Scientific LTQ Orbitrap Velos)
- 高精密度質量分析装置 (2)  
(Thermo Fisher Scientific Exactive)
- 高精密度質量分析装置 (3)  
(Thermo Fisher Scientific TSQ Vantage)




**未来科学技術共同研究センター**

- ウェットベンチ (無機用・高洗浄)  
(日立プラント HNCD-4-SL#1)
- ウェットベンチ (無機用・汎用)  
(日立プラント HNCD-4-SL#2)
- ウェットベンチ (無機用・メタル専用)  
(日立プラント HNCD-4-SL#3)
- ウェットベンチ (有機用・リソグラフィ)  
(日立プラント HNCD)
- 特殊型 Si ウェハ洗浄乾燥装置  
(SES 200SP)
- KrF ステッパ  
(キヤノン FPA3000-EX3)
- コータペロウパ  
(東京エレクトロン Mark8)
- アライナー  
(ユニオン光学 EMA-400)
- 中電流イオン注入装置  
(日新イオン機器 EXCEED2300AH)
- 低温拡散炉・水素処理炉  
(東京エレクトロン BEOL 炉 α-8SE)
- プラズマ酸化・窒化  
(RLSA 2B)
- LPCVD 装置  
(東京エレクトロン Formula)
- マイクロ波プラズマ CVD 装置 (SiN)  
(東京エレクトロン LT-PECVD)
- 常圧 CVD 装置  
(光洋サーモシステム PYROX-216E)
- マイクロ波 Si・絶縁膜 RIE 装置  
(東京エレクトロン BED)
- 特殊型室温枚葉洗浄装置 A  
(リアライズ・アドバンステクノロジ 金属薄層用洗浄装置)
- 特殊型密閉型洗浄装置 B  
(リアライズ・アドバンステクノロジ)
- 電子ビーム露光装置  
(クレステック CABL-9520CE)
- RTA 装置 B  
(光洋サーモシステム RLA-1208-V)
- 高温熱処理装置 (1200°C)  
(V&H テクノロジーズ VD-8-300S)
- Cu めっき装置  
(荏原製作所 DMP200FU)
- Cu アンニール装置  
(東京応化 HLB1211WL)
- Cu・Ta・Ti スパッタ装置  
(アルバック ENTRON W-200)
- クラスターパッチ装置  
(和泉テック IZU-2500H)
- 汎用酸素ラジカル処理装置  
(和泉テック)
- FTS スパッタリング装置  
(エフ・ティ・エスコポレーション)
- オールメタル装置 (プラズマ平坦化)  
(和泉テック)
- 33mm プラズマチャンバー装置 (MO)  
(和泉テック)
- ワイヤーボンダー  
(新川 UTC-1000)
- CMP 装置  
(ARACA APD-800X)
- CMP 後洗浄装置  
(リアライズ・アドバンステクノロジ)
- 蛍光 X 線分析装置 (XRF)  
(SII ナノテクノロジー SEA1000A)
- パーティクル検査装置 A  
(トプコン WM2500)
- XRD  
(PANalytical/Spectris X'pert MRD)
- 分光エリプソメトリー  
(堀場製作所 UVISEL/M200-VIS)
- 低温プローバ  
(ナガセ電子機器 ARK-LIPS)
- FE-SEM  
(JEOL JSM-6700F)
- 顕微鏡  
(オリンパス MX50)
- 抵抗率測定器  
(国際電気アルファ VR-120S)
- 全反射蛍光 X 線装置  
(テクノス TREX610Tx)
- 段差計  
(Bruker Nano Deactac 6M)
- 300mm 高周波対応マニュアルプローバ  
(ベクターセミコン)
- マニュアルプローバ cascade 8inch, 1/f ノイズ  
計測システム付  
(Cascade Microtech)
- 薄膜密度計  
(NEC 三栄 MH4000)
- n&k 測定装置  
(n&k Technology)
- RTA 装置 B  
(光洋サーモシステム RLA-1208-V)
- ソーラシミュレータ  
(ワコム電創 WXS-90S-L2)
- 微細表面構造計測顕微鏡  
(荏原製作所 SFT-3500 MS-200AS)
- 差動排気型電子分光分析 (XPS) 装置  
(ScientaOmicron R4000-Hipp2)
- マイクロピッカーズ硬度計  
(島津製作所 HIMV-21DT)
- 顕微赤外分光装置  
(日本分光 FT/IR-6300, IRT-5000)
- 表面粗さ測定器  
(ミツトヨ SV-3100SA)
- 200mm ウェハ対応原子間力顕微鏡  
(サカタ理化学 N9455A)




**学術資源研究公開センター**

- 高分解能 CT スキャンシステム  
(コムスキャンテクノ ScanXmate-D160TSS105/11000 他)




**工学研究科**

- 透過型電子顕微鏡 (FE-TEM)  
(JEOL JEM-2100F)
- 走査型電子顕微鏡・結晶方位解析  
(FE-SEM/EBSDF) (JEOL JSM-7100F)
- 多次元材料組成分析システム  
(JEOL JSM-8500F)
- 三次元微小構造解析システム  
(JEOL JEM-ARM200F(UHR), JIB-4600F)
- 実変動風荷重装置




**医工学研究科**

- 生体用高速多光子共焦点レーザー顕微鏡  
システム  
(ニコン A1RMP-MR, ライカマイクロ  
システムズ TSC SP8 STED)
- 助起用フェムト秒レーザー発生装置  
(ニコン MaiTaiDS-NT70)
- 波長可変パラメトリック増幅器分光  
イメージングシステム  
(フレスト)
- 超精密生体分子分析装置
- 生体機能画像解析装置  
(ライカマイクロシステムズ)
- 生体適合デバイス特性測定装置  
(セラバス 128ch システム)
- 硬組織三次元形態解析装置
- ナノイメージング解析装置
- 多波長画像解析装置  
(フリアーシステムズ SC4000-YMR)
- 生体モデル分析装置
- 神経細胞活動記録解析装置
- 生体電気現象解析処理装置  
(ソートロン)
- 多機能生理学実習装置  
(BIOPAC Systems)
- マウス・ラット自動飼育装置システム  
(KIS-160WTU)
- 高解像度超音波画像解析装置  
(TKSHD-10CH101)
- 純水・超純水製造装置  
(ミリポア)




**巨大分子解析研究センター**

- 核磁気共鳴装置  
(JEOL JNM-ECA700)
- 核磁気共鳴装置  
(Bruker BioSpin AVANCE III 700)
- 質量分析装置 (フーリエ変換質量分析装置)  
(Bruker solarix-TOH1 9.4T)
- 質量分析装置 (ガスクロマトグラフ飛行時間  
質量分析装置)  
(JEOL JMS-T100GCV)
- X 線構造解析装置 (単結晶自動 X 線構造解析  
装置)  
(リガク Vari Max with RAPID)
- 微量分析装置 (有機ハロゲン・硫黄分析  
システム)  
(ヤナコ機器開発研究所 YHS-11)
- 微量分析装置 (炭素・水素・窒素同時定量装置  
マイクロコーダー)  
(ジェイ・サイエンス JM11)
- 発光分析装置 (高周波プラズマ発光分析装置)  
(島津製作所 ICPE-9000)
- X 線構造解析装置 (CCD 搭載高精度 X 線構造  
解析システム)  
(Bruker AX ULTRA/THK)
- 800MHz 超伝導核磁気共鳴装置  
(JEOL JNM-ECA800)




**サイクロトロン・  
ラジオアイソトープセンター**

- 高速イオン・中性子ビーム照射装置  
(陽子・中性子 70MeV、重イオンビーム)
- ポジトロン放出断層装置 (PET)  
(島津製作所 Eminence)
- 粒子加速装置 (医用小型サイクロトロン)  
(住友重機械工業 CYPRIS-HM12)
- 小動物用 PET・CT 装置  
(島津製作所 ClairvivoPET・CT)



**災害科学国際研究所**

- 真空凍結乾燥システム  
(宝製作所 TF20-80TNNN)



**イノベーション戦略推進本部**

- 非接触三次元形状測定装置  
(三鷹光器 NH-3SP)
- 2光子助起顕微鏡システム  
(ライカマイクロシステムズ)
- 電子ビーム描画装置 (エリオニクス ELS-F125)
- 超微細インジェクト装置  
(SIJ テクノロジ PR-150THU)
- 昇温脱離分析装置 (電子科学 WA1000)